# ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ

УДК 537.52, 537.53

# ДИАГНОСТИКА СИЛЬНОТОЧНОГО НЕРАСПЫЛЯЮЩЕГО МАГНЕТРОННОГО РАЗРЯДА В ВОДОРОДЕ

© 2024 г. А. В. Казиев<sup>а, b,</sup> \*, Д. В. Колодко<sup>а, b, c</sup>, Н. С. Сазонов<sup>а</sup>, М. М. Харьков<sup>а</sup>, А. В. Тумаркин<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

Каширское шоссе, 31, Москва, 115409 Российская Федерация

<sup>b</sup>Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,

Ленинский просп., 53, Москва, 119991 Российская Федерация

<sup>c</sup>Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,

пл. Введенского, 1, Фрязино, Московская обл., 141190 Российская Федерация

\*E-mail: kaziev@plasma.mephi.ru

Поступила в редакцию 23.12.2023 г.

После доработки 15.03.2024 г.

Принята к публикации 25.03.2024 г.

Проведены эксперименты по диагностике плазмы нераспыляющего разряда миллисекундной длительности в водороде при давлении ~ 1 Торр, длительности и максимальной мощности импульса соответственно около 1 мс и 80 кВт. Показано, что применение импульсных нераспыляющих режимов магнетронного разряда в легких газах позволяет получать плотную неконтрагированную плазму при отсутствии в спектрах оптического излучения линий, соответствующих частицам материала катода или анода.

*Ключевые слова*: нераспыляющий магнетронный разряд, дуговой разряд, водород, оптическая эмиссионная спектроскопия

DOI: 10.31857/S0033849424110078, EDN: HOFBOQ

# **ВВЕДЕНИЕ**

В настоящее время в ряде областей практических применений, таких как сухое травление материалов, создание плазменных двигателей, проведение испытаний материалов при высоких термических и плазменных нагрузках, требуются эффективные источники чистой газовой плазмы с высокой степенью ионизации. В качестве такого источника можно рассмотреть сильноточный импульсный магнетронный разряд (СИМР) [1], либо его версию с короткими импульсами (high-power impulse magnetron sputtering, HiPIMS) [2]. Однако в силу того, что СИМР и HiPIMS сочетают в себе высокий ток и достаточно большое напряжение, они преимущественно используются для осаждения покрытий и, следовательно, в своей традиционной форме не пригодны для создания плазмы, в которой нет заметной доли металлических частиц. Использование легкого рабочего газа (водорода или гелия) позволяет существенно снизить эффекты распыления и превратить этот тип разряда в высокоэффективный генератор беспримесной газовой плазмы.

В зависимости от условий эксплуатации (в том числе длительности импульса) возможен перевод режима HiPIMS с большой длительностью (СИМР или L-HiPIMS) в нераспыляющий низковольтный режим на том же уровне мощности. Этот режим известен как нераспыляющий магнетронный разряд (НРМР) [3, 4]. Применение в качестве плазмообразующих газов водорода или гелия может привести к генерации плазмы высокой плотности с чрезвычайно низкой скоростью эрозии материала катода, что интересно для применений в области коммутации тока [5—7].

Цель данной работы — провести диагностику плазмы нераспыляющего разряда миллисекундного масштаба в водороде при давлении 1...2 Торр.

# 1. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Эксперименты проводили в специальном разрядном устройстве, представляющем собой антипробкотрон (ловушка с встречными магнитными полями) с парой электродов, форма которых повторяет кривизну силовых линий магнитного поля (подробнее см. [2]). Катод выполнен из меди, источником питания служила искусственная

длинная линия. Напряжение зарядки линии было задано в диапазоне от 600 до 2500 В. Подача напряжения на электроды осуществлялась с помощью тиристора. Для подачи управляющего сигнала использован генератор задержанных импульсов Stanford Research Systems DG645, и он также был использован для синхронизации записи осциллограмм и спектров оптического излучения.

Длительность разряда составляла более 1 мс. Напряжение разряда во время импульса измерялось дифференциальным пробником Pintek DP-50. Ток разряда измерялся токовым датчиком Pintek PA-622 (рассчитан на максимальный ток 200 A) и поясом Pоговского RFSY-70—50. В большинстве экспериментов датчик тока Pintek PA-622 выходил за пределы заявленного предела измерений, однако позволял быстро оценить поведение разряда, без необходимости пересчета тока по сигналу пояса Роговского. Сигналы с датчиков регистрировались цифровым четырехканальным осциллографом АКИП-4126/3A-X.

Наличие примесей в плазме определяли с помощью трехканального оптоволоконного спектрометра Avantes AvaSpec ULS2048L с тремя спектральными диапазонами: 200...365, 364...603 и 600...810 нм и с разрешениями соответственно 0.12, 018 и 0.15 нм. Спектры излучения плазмы измеряли через акриловое окно с полосой пропускания ~ 370...2000 нм. Наличие того или иного элемента в плазме определяли по появлению устойчивых линий согласно базе данных атомных спектров NIST. Оптическое излучение плазмы собиралось линзой и передавалось по оптоволокну в каналы спектрометра. Время экспозиции было зафиксировано на минимальном доступном для устройства значении и составляло 1.050 мс.

Запись спектра синхронизировалась с передним фронтом импульса напряжения.

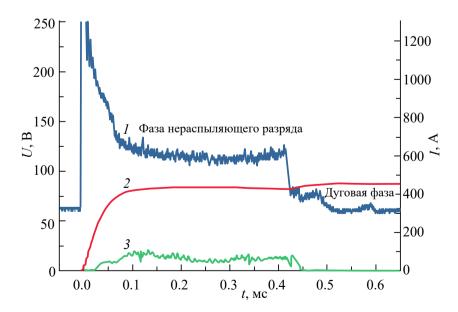
Концентрацию плазмы определяли электростатическим зондом в режиме ионного насыщения.

#### 2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖЛЕНИЕ

При отсутствии ограничения длительности импульса, в конечном итоге, HPMP характеризуется переходом в дуговой режим. Типичные осциллограммы тока и напряжения в случае HPMP с переходом в дугу показаны на рис. 1 вместе с сигналом ионного тока, поступающего на зонд.

Из-за высокой импульсной мощности (около десятков киловатт) такие дуги наносили видимые повреждения поверхности катода, а спектры, полученные методом оптической эмиссионной спектрометрии, в дуговом режиме содержали интенсивные линии излучения частиц металла. Типичный спектр оптического излучения дугового разряда показан на рис. 2. Эти данные свидетельствуют о наличии в плазме частиц Си и Си<sup>+</sup>, а также о высокой степени ионизации плазмы.

Тем не менее HPMP может существовать в течение нескольких милисекунд без перехода в дугу. Спектр, характерный для разряда HPMP, представлен на рис. 3. В отличие от спектра дуги, здесь присутствуют только линии, соответствующие рабочему газу (водороду). Максимальная измеренная плотность плазмы сильноточного импульсного нераспыляющего магнетронного разряда в водороде составила  $1.8 \times 10^{20} \,\mathrm{m}^{-3}$  при среднем токе разряда  $1200 \,\mathrm{A}$  (ток, поступающий на зонд,  $0.9 \,\mathrm{A}$ ). Степень ионизации при этом составила около 20%.



**Рис. 1.** Осциллограмма развития разряда, с переходом от HPMP к дуговому разряду: 1 — напряжение разряда, 2 — ток разряда, 3 — ток, поступающий на зонд ( $\times 10^3$ ).

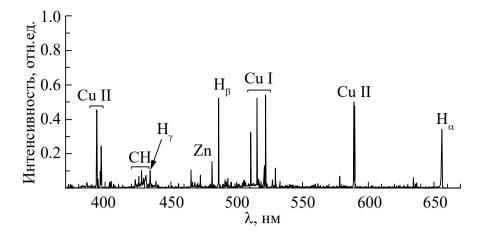


Рис. 2. Спектр излучения плазмы дугового разряда.

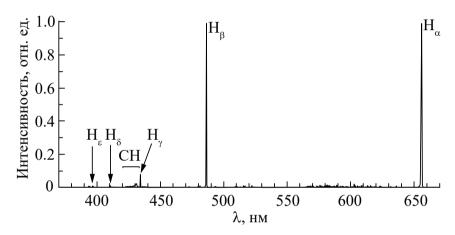


Рис. 3. Спектр излучения плазмы нераспыляющего магнетронного разряда.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определены концентрация плазмы, ее состав и степень ионизации в сильноточном нераспыляющем магнетронном разряде. Для водорода максимальная измеренная плотность плазмы составила  $1.8 \times 10^{20} \text{ м}^{-3}$  при степени ионизации порядка 20%. Для этого режима характерно подавление эрозии электродов. Использование импульсных нераспыляющих режимов в легких газах позволяет получать неконтрагированную плазму с высокой плотностью и отсутствием оптического излучения частиц материала катода или анода.

# КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы данной работы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

# ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых

российских ученых — кандидатов наук (проект № МК-4445.2022.4), а также частично поддержана государственным заданием ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Мозгрин Д. В., Ходаченко Г. В., Фетисов И. К.*// Физика плазмы. 1995. Т. 21. № 5. Р. 422.
- 2. Gudmundsson J. T., Brenning N., Lundin D., Helmersson U. // J. Vac. Sci. Technol. A. 2012. V. 30. № 3. P. 030801.
- 3. *Ходаченко Г. В., Мозгрин Д. В., Фетисов И. К., Степанова Т. В.*// Физика плазмы. 2012. Т. 38. № 1. С. 71.
- 4. Kaziev A. V. // Vacuum. 2018. V. 158. P. 191.
- Sommerer T. J., Aceto S. C., Trotter J. F. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2019. V. 52. № 43. P. 435202.
- 6. Smith D. J., Sommerer T. J., Lawler J. E., Hitchon W. N. G. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2021. V. 54. № 29. P. 295201.
- 7. *Levko D.*, *Raja L. L.* // J. Appl. Phys. 2022. V. 132. № 24. P. 243301.

# DIAGNOSTICS OF A HIGH-CURRENT NON-SPUTTERING MAGNETRON DISCHARGE IN HYDROGEN

A. V. Kaziev<sup>a, b, \*</sup>, D. V. Kolodko<sup>a, b, c</sup>, N. S. Sazonov<sup>a</sup>, M. M. Kharkov<sup>a</sup>, A. V. Tumarkin<sup>a</sup>

<sup>a</sup> National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute),
 31 Kashirskoe sh., Moscow, 115409 Russian Federation
 <sup>b</sup> Lebedev Physical Institute of RAS,
 53 Leninskiy prosp., Moscow, 119991 Russian Federation
 <sup>c</sup> Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics of RAS, Fryazino Branch,
 1 Vvedenskogo pl., Fryazino, Moscow Region, 141190 Russian Federation
 \*E-mail: kaziev@plasma.mephi.ru

Received December 23, 2023, revised March 15, 2024, accepted March 25, 2024

The experiments were carried out to characterize plasma of a non-sputtering millisecond discharge in hydrogen at a pressure of  $\sim 1$  Torr, pulse duration and a maximum impulse power near 1 ms and 80 kW, correspondingly. It has been demonstrated that the implementation of impulse non-sputtering modes of a magnetron discharge in light gases enables generation of dense non-constricted plasma with no lines of cathode or anode material present in its optical emission spectra.

Keywords: non-sputtering magnetron discharge, arc discharge, hydrogen, optical emission spectroscopy